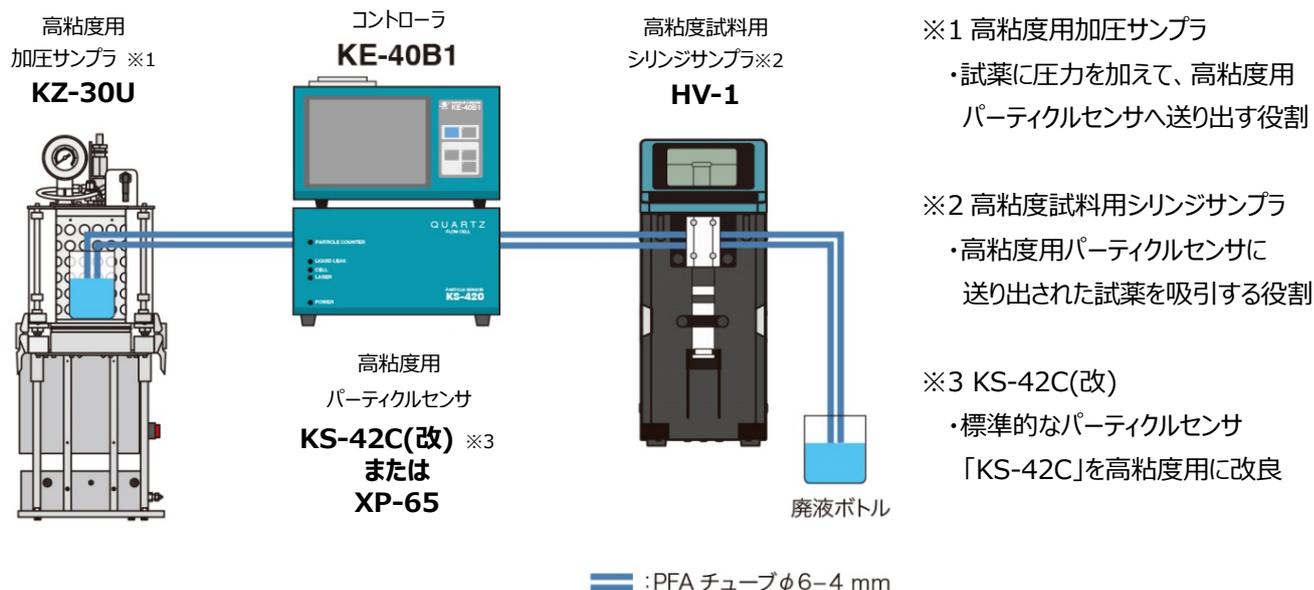


高粘度用パーティクルセンサを用いた測定システムの構成例（厚膜レジスト、ワニス、ポリイミドに適用）

<液中微粒子測定システム>



■ 高粘度試料用シリンジサンブラ「HV-1」

- 主な特長： (1) 5 Pa・s (5,000cP) の高粘度試料の測定が可能
(2) 高粘度KrF、厚膜レジスト、ワニス、ポリイミドの原液測定が可能
(3) 耐圧0.3MPaを有し、高粘度用加圧サンブラの加圧上限である0.2MPaに対応

■ 高粘度な試料の種類や粘度、定格流量、最小可測粒径などに応じた測定システムの構築が可能

本システムの性能と構成

○ 高粘度な試料の種類・粘度、適応するパーティクルセンサ

試料名	粘度 (Pa・s)	適応するパーティクルセンサ
厚膜レジスト	1~6	高粘度用パーティクルセンサ KS-42C (改)、XP-65
ワニス、ポリイミド	3~4	高粘度用パーティクルセンサ KS-42C (改)、XP-65
高粘度KrF	0.1~1.5	標準的なパーティクルセンサ KS-41、KS-42の各シリーズ

○ パーティクルセンサ別の最大吸引可能試料粘度（加圧:0.2MPaの場合）

	型式	最大吸引可能粘度 (Pa・s)	定格流量 (mL/min)	最小可測粒径 (μm)
標準的なパーティクルセンサ	KS-41A	0.5	10	0.15
	KS-42B	0.2	10	0.2
	KS-42C	0.5	10	0.5
高粘度用パーティクルセンサ	XP-65	5	3	0.2
	KS-42C (改)	5	3	0.5

■ 高粘度試料の液中微粒子測定システム

測定システムの各製品名称

- (左) 高粘度用加圧サンブラ KZ-30U
(中上) コントローラ KE-40B1
(中下) 高粘度用パーティクルセンサ KS-42C(改)
(右) 高粘度試料用シリンジサンブラ HV-1

